



# 高真空阀 XL□ · XM□ · XY□系列

在半导体制造过程中，腐蚀装置、喷镀装置，离子注入装置和CVD装置等许多部分，都要把芯片和液晶基板放在真空室内处理，该真空室供气、排气(真空)用阀，要求它们无泄漏、耐腐蚀且是洁净规格。

品 种	系列	控 制 方式	阀形式	密封方式	使用压力 (Pa)	泄漏量(Pa · m <sup>3</sup> /S)		耐久性 (万次)	用 途	使用温度	控制口压力	产品样 本编号			
						内部	外部								
铝 阀    直角型 (L型)	XLA	气 控 式	单作用 (N.C.)	波纹管密封	10 <sup>5</sup> ~10 <sup>6</sup>	1.3 × 10 <sup>-10</sup>	1.3 × 10 <sup>-11</sup>	200	无微粒 完全洁净化	5~60℃ (高温型: 5~150℃)	0.4~0.7MPa	CAT.C-EP -ZA			
	XLC		双作用												
	XLF		单作用 (N.C.)	O形圈密封	10 <sup>5</sup> ~10 <sup>5</sup>				1.3 × 10 <sup>-10</sup>		防止微粒卷起 防止泵过载		0.3~0.6MPa		
	XLG		双作用												
	XLD		单作用 (N.C.)	波纹管 · O形圈密封	10 <sup>5</sup> ~10 <sup>6</sup>				1.3 × 10 <sup>-11</sup>		10		无微粒 完全洁净化	5~150℃	—
	XLH		手动式	手动	波纹管密封										
	XLS	电磁式	单作用 (N.C.)	(波纹管平衡)	2 × 10 <sup>5</sup> ~ 10 <sup>6</sup>	10 <sup>8</sup>	50	不用压缩空气 手提式装置用							
不锈钢阀    直角型 (L型)	XMA	气 控 式	单作用 (N.C.)	波纹管密封	大气压力 ~10 <sup>6</sup>	1.3 × 10 <sup>-10</sup>	1.3 × 10 <sup>-11</sup>	200	无微粒	5~60℃ (高温型: 5~150℃)	0.4~0.7MPa	CAT.S140 -5A			
	XMC		双作用												
	XMD		单作用 (N.C.)	波纹管 · O形圈密封					防止微粒卷起 防止泵过载		0.4~0.7MPa				
	XMH	手动式	手动	波纹管密封											
直通型 (Y型)  	XYA	气 控 式	单作用 (N.C.)	波纹管密封					无微粒	5~60℃ (高温型: 5~150℃)	0.4~0.7MPa				
	XYC		双作用												
	XYD		单作用 (N.C.)	波纹管 · O形圈密封					防止微粒卷起 防止泵过载		0.4~0.7MPa				
	XYH	手动式	手动	波纹管密封											